



Japio-GPG/FX

Japio世界特許情報全文検索サービス

新機能リリース

(2015年7月31日リリース予定)

株式会社発明通信社

一般財団法人日本特許情報機構

Japio-GPG/FX



拡張機能

- (1)中国機械翻訳未知語かぶせ機能
- (2)全言語検索機能
- (3)PCTミニドク国・機関選択機能
- (4)ファミリー除外機能
- (5)Espacenetリンク機能
- (6)サマリー表示機能
- ・検索クエリー指定方法の改善
- ・ハイライト機能の改善
- ・表示機能の改善



(1) 中日機械翻訳未知語かぶせ機能 ～機能説明～

Japio-GPG/FXでは、中日機械翻訳処理において翻訳ができない用語（未知語）が発生した場合は、未知語（中国語）を【】（墨付きカッコ）で括り表示しています。

本機能では、Japio独自の中日用語テーブルを利用し、未知語を日本語に置き換えて表示します。

1. 表示時に日本語に置き換えられた用語は《》で括られて表示されます。
2. 日本語に置き換えられた用語にマウスのカーソルを重ねると置き換え前の用語（中国語）が表示されます。

《注意》

1. 本機能で置き換えられた日本語は検索ではヒットしません。
2. 置き換えられる前の用語（中国語）で検索した場合は、本機能は動作せず、中国語が表示されます。

(1) 中日機械翻訳未知語かぶせ機能 ～画面例～

	側面)外側に延在する方向をx軸正(+)方向, x軸+方向と反対の方向にx軸負方向として(-)方向。
0中的与安装有拍摄芯片 0中的安装有拍摄芯片 基板120具有从该芯基板 的宽度是例如上述的一侧 是123的宽度短。延伸部	チップ撮像100コア基板実装120。ここで(図示なし), しかしコア基板120における実装撮像チップ100られる面とは反対側の面に電子部品が実装されている。この明細書で, コア基板120における装着撮像チップ100面をチップ実装面として, 電子部品の面を取り付け面が装着されている。コア基板120 このコア基板の一方の出側から(紙面の右側側面)をx軸+方向へ延びる延《延部》151。延出部151その幅は例えば上記した一側面のy軸方向の幅の半分程度。すなわち, 延出部151の幅は後述するコア層123の幅よりも短い。《延部》151上記の一側面におけるy軸方向の中央部分から延びる。

本機能にて置き換えられた日本語表示です。

マウスのカーソルを重ねるとかぶせ前の用語(中国語)が表示されます。



(2)全言語検索機能 ～機能説明～

Japio-GPG/FXでは日本語・英語・中国語のみ検索対象としていましたが、新たにフランス語や韓国語など、データベースに蓄積されている言語全てを検索できるようにしました。

1. 項目検索画面では全ての原語を混在して指定することができます。
2. 検索クエリーで指定できる全言語用の検索タームを新設しました。

1. タイトル :TI (蓄積されている全てのデータのタイトルを検索)
2. 要約 :AB(蓄積されている全てのデータのタイトルを検索)
3. クレーム :CL(中国公報(中国語)のクレームを除き検索)
4. 詳細な説明 :DS(中国公報(中国語)の詳細な説明を除き検索)
5. 上記4項目全て:AL

《注意》

1. PCT公報の言語の内、下記言語のインデックスの作成規則は以下の通りです。
韓国語…スペース区切り、中国語・日本語…1Nグラム



(2)全言語検索機能 ～画面例～

検索項目		検索	クリア
<input checked="" type="checkbox"/> 発明の名称 (TI)	プリント+printer+Drucker+imprimeur+打印机+프린터		
<input checked="" type="checkbox"/> 要約 (AB)	AND演算 inkjet printer インクジェット プリンタ インクジェット inkjet		
<input type="checkbox"/> クレーム (CL)	OR演算 laser+inkjet レーザー+インクジェット インクジェット+inkjet ※中国・日本クレームは英語データ無し		
<input type="checkbox"/> 詳細な説明 (DS)			

日本語・英語・中国語の他、独語、仏語、韓国語などの指定が可能です。

検索クエリー

TI:(プリント+printer+Drucker+imprimeur+打印机+프린터)

全言語用の検索ターム(TI等)を利用して検索します。
※検索式の指定方法も改善しました。詳細は次ページ以降をご参照ください。

ABJ:インクジェット AND ABJ:プリンタ
IC:A01B* AND (ABJ:インクジェット
OR ABE:inkjet)
※演算子(AND,OR,NOT)は大文字



(3)PCTミニドク国・機関選択機能

～機能説明&画面例～

PCTミニドク国および機関を対象とした検索を行う場合、国・機関指定をワンクリックで選択できる機能です。

○ PCTミニドク国および機関

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 AP (ARIPO) | 11 FR (フランス) |
| 2 AT (オーストリア) | 12 GB (イギリス) |
| 3 AU (オーストラリア) | 13 JP (日本) |
| 4 CA (カナダ) | 14 KR (大韓民国) |
| 5 CH (スイス) | 15 OA (OAPI) |
| 6 CN (中国) | 16 RU (ロシア連邦) |
| 7 DD (ドイツ民主共和国) | 17 SU (ソビエト連邦) |
| 8 DE (ドイツ) | 18 US (アメリカ合衆国) |
| 9 EA (EAPO) | 19 WO (WIPO) |
| 10 EP (EPO) | |

<input checked="" type="checkbox"/> 5 庁 + P C T 選択／選択解除	(CP)
出願日 (AD)	
公報発行日 (PD)	
出願番号 (AN)	
文献番号 (PN)	
優先権主張番号 (PR)	

国指定選択 [クリア]

AP AT AU CA CH
CN DD DE EA EP FR
GB JP KR OA RU SU
US WO

PCTミニドク国・機関

PCTミニドク国・機関をチェックします。



(4) ファミリー除外機能 ～機能説明&画面例～

検索結果の回答から、パテントファミリーに含まれる国を指定して、除外する機能です。

除外指定が可能な国は5庁+PCTです。

代表ファミリー表示
日本語代表表示(J)
英語代表表示(E)
非英語代表表示(N)

JP US EP
PCT CN KR
ファミリー除外

1.
RESOURCE ELEMENT MAPPING FOR WIRELESS TRANSMISSIONS
【E J】無線送信用のリソースエレメント・マッピング

出願人：英特尔公司
(INTEL CORP(INTEL CORPORATION))
発明者：J.曹; S.张
(CAO JINYU; ZHANG SENJIE(CAO JINYU; ZHANG SENJIE))
出願番号：CN201280072867.7 (CN2012872867) [2012-06-01]
文献番号：CN104255076A (CN104255076A) [2014-12-31]
IPC：H04W72/04[200601](H04W72/04)
要約（日）：【E J】基地局とユーザ装置デバイスの間の無線送信はリソースマッピング規則を使用して行なわ
則はリソースブロック説明に基づいて生成されてもよい。リソースブロック説明は、シンボルタイプの定義済み
まれたシンボルとの一致により決定されてもよい。シンボルタイプは伝送特性に基づいて決定されてもよい。

パテントファミリー： [ファミリー一覧表示](#)
・ WO2013177788A1 E · US2014119330A1 · CN104255076A · EP2856818A1

国・機関をチェックして
「ファミリー除外」ボタンを
押します。



(5) Espacenetリンク機能

～機能説明&画面例～

詳細表示画面から、Espacenetの検索画面を開くリンクを追加しました。



別ウインドウで
Espacenet検索画面
(日本語)が開きます。

1. 用于无线传送的资源元素映射
RESOURCE ELEMENT MAPPING FOR WIRELESS TRANSMISSIONS
【E】 無線送信用のリソースエレメント・マッピング
出願人: 英特尔公司
(INTEL CORP(INTEL CORPORATION))
発明者: J.曹; S.張
(CAO JINYU; ZHANG SENJIE(CAO JINYU; ZHANG SENJIE))
出願番号: CN201280072867.7(CN2012872867) [2012-06-01]
文献番号: CN104255076A (CN104255076A) [2014-12-31] 公報PDF フロントPDF
IPC: H04W72/04(200601)(H04W72/04)
ECLA:
CPC: H04W72/042; H04W72/1263
優先権主張番号: WO2012CN76370



9

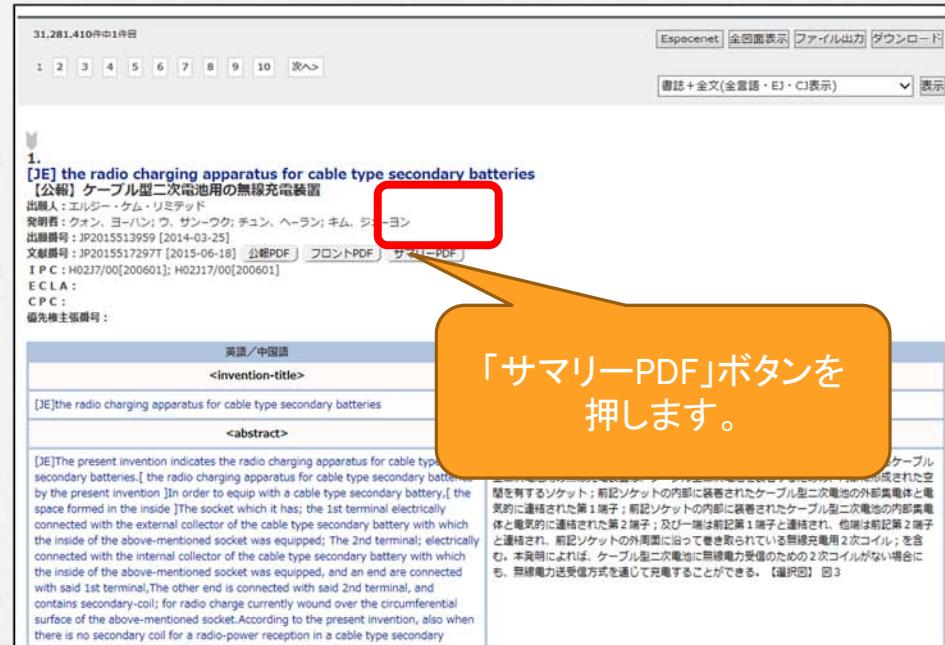
Japio-GPG/FX



(6) サマリー表示機能

～機能説明&画面例～

発明通信社のサマリーをPDF形式で表示します。
日本とアメリカの文献のみです。



31,281,410件中1件目

Especenet 全画面表示 ファイル出力 ダウンロード

書誌+全文(全言語・EJ・CJ表示) 表示

1. [DE] the radio charging apparatus for cable type secondary batteries
【公報】ケーブル型二次電池用の無線充電装置

出願人: エルジー・ケム・リミテッド
発明者: クォン、ヨー/ジ; ワ、サン-ウク; チュン、ヘーラン; キム、ジ-ヨン
出願番号: JP2015513959 [2014-03-25]
文献番号: JP2015517297T [2014-06-18] 公報PDF フロントPDF サマリーPDF
IPC: H02J7/00[200601]; H02J17/00[200601]
ECLA:
CPC:
優先権主張箇号:

英語/中国語 <invention-title>
[DE]the radio charging apparatus for cable type secondary batteries

<abstract>

[DE]The present invention indicates the radio charging apparatus for cable type secondary batteries. The radio charging apparatus for cable type secondary batteries, by the present invention, is in order to equip with a cable type secondary battery, the space formed in the inside of the socket which it has; the 1st terminal electrically connected with the external collector of the cable type secondary battery with which the inside of the above-mentioned socket was equipped; The 2nd terminal; electrically connected with the internal collector of the cable type secondary battery with which the inside of the above-mentioned socket was equipped, and an end are connected with said 1st terminal; The other end is connected with said 2nd terminal, and contains secondary-coil; for radio charge currently wound over the circumferential surface of the above-mentioned socket. According to the present invention, also when there is no secondary coil for a radio-power reception in a cable type secondary

ケーブル型二次電池用の無線充電装置

「サマリーPDF」ボタンを押します。

公開サマリー

- 1.書誌事項
- 2.出願人要約
- 3.産業上の利用分野または技術分野
- 4.請求の範囲
- 5.作用
- 6.図面の簡単な説明・符号の説明
- 7.図面

登録サマリー

- 1.書誌事項
- 2.産業上の利用分野
- 3.目的または効果
- 4.請求の範囲
- 5.作用
- 6.図面の簡単な説明・符号の説明
- 7.図面



(6) サマリー表示機能

～画面例（JP公開特許サマリー）～

公開特許サマリー

特開2015-1

審査請求・未請求・請求項の数

(43)公開日 平成27年(2015)1月5日

(3) (全) 20頁

(51)Int.Cl.

A 01 K	67/027	(2006.01)
G 01 N	33/15	(2006.01)
G 01 N	33/50	(2006.01)
C 12 N	15/00	(2006.01)

F 1

(21)特願2013-124206

(71)登録人	株式会社明治研究	東京都千代田区麹町1丁目5番1号
(72)登録代理人	野口一	株式会社明治研究本部内
(72)発明者	土橋英恵	株式会社明治研究本部内
(72)発明者	池上秀二	株式会社明治研究本部内
(72)発明者	伊藤裕之	株式会社明治研究本部内

【発明の範囲】 退歯性歯症候群モデル動物の作成方法

(57)【要約】

【図版】

本発明の範囲は、慢性的な下痢を誘導した退歯性歯症候群の歯列生ずる動物を作製する方法であります。

【図版の説明】

本発明では、免疫低下によって歯肉細菌の異常増殖をおきること、および歯肉細菌の異常増殖が退歯性歯症候群の発症につながることに目を向ける。このことから、動物に免疫抑制剤を投与することで慢性的な下痢が誘導されることを見出し、本発明を完成させた。

「続きあり」

【技術分野】

本発明は、下痢症の過敏性歯症候群モデル動物の作製方法、および下痢症の過敏性歯症候群の治療に有効なプロトコルに関する技術である。

【発明が解決しようとする課題】

本発明の範囲は、慢性的な下痢を誘導した退歯性歯症候群の歯列生ずる動物を作製する方法であります。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

過敏性歯症候群動物に、免疫抑制剤を投与することを特徴とする、慢性的下痢誘導方法。

【請求項2】

請求項1に記載の方法により、慢性的下痢が誘導された後、過敏性歯症候群の歯列生ずる動物。

【請求項3】

請求項2に記載の方法により、慢性的下痢が誘導された後、過敏性歯症候群の歯列生ずる動物を作製する方法。

【請求項4】

請求項3に記載の方法により、過敏性歯症候群モデル動物を作製し、その過敏性歯症候群歯列生ずるモデル動物に被検物質を投与し、さらには運動において、下痢症、消化吸収能、内因性吸収能が異なる群から選ばれた少なくとも3種以上を投与することを特徴とする、過敏性歯症候群歯列生ずるを促進又は抑制する物質のスクリーニング方法。

【請求項5】

請求項1に記載の方法により得られる、慢性的下痢が誘導された後、免疫不全型による下痢のモデル動物。

【請求項6】

請求項1に記載の方法により得られる、慢性的下痢が誘導されたヒトヒト乳動物を取得することを含む、免疫不全型による下痢のモデル動物の作製方法。

出す。

【図1】実施例3において、由中の $Granulysin$ 濃度を測定した結果、mean \pm SE(n=7)を示す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

*:

*: p<0.01. (Student's t-test)。

【審査請求の範囲】

【テマーカード】 (参考)

26045

48024

【「ターム」 (参考)】

26045 A29

48024 A41 CA09 HA12

【図面の簡単な明細】

【図1】実施例1において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図2】実施例1において、由中の $Granulysin$ 濃度を測定した結果。グラフはmean \pm SE(n=7)を示す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図3】実施例2において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図4】実施例2において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図5】実施例2において、Bacterial Translocationを検出した結果を示す。グラフはBacterial Translocationの陽性性を表す。

【図6】実施例2において、回腸壁の $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05. (Student's t-test)。

【図7】実施例3において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図8】実施例3において、回腸壁の $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05. (Student's t-test)。

【図9】実施例3において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図10】実施例3において、菌便の状況を評価した結果。グラフは免疫不全アーモン:mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図11】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図12】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図13】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図14】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図15】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図16】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図17】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図18】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

【図19】実施例4において、回腸壁における $Reg3\gamma$ の遺伝子発現量を測定した結果を示す。グラフは $Reg3\gamma$ に対する β -actinのRNA発現量について、mean \pm SE(n=7)を表す。*: p<0.05。*: p<0.01. (Student's t-test)。

特開2015-1

- 1 -

21 (株) 明治研究社

- 2 -

11



(6) サマリー表示機能

～画面例（US公開特許サマリー）～

『USサマリー』

US 20150000001 A1

5

(19) United States

(21) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 20150000001 A1

(45) Pub. Date: Jan. 1, 2015

(54) APRON HAVING ELASTIC WAIST AND ZIP CLOSURE (52) U.S. CL. A41D 13/04 (2013.01); A41D 13/00 (2013.01)

(71) Applicant: Monroe Jackson, SR., Jackson, MS USPC: 2/82

(72) Inventor: Monroe Jackson, SR., Jackson, MS (US)

(21) Appl. No.: 14/486,383

(22) Filed: Sep. 15, 2014

Related U.S. Application Data

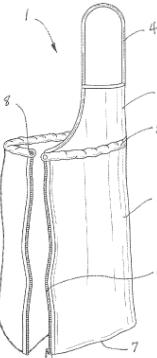
(63) Continuation-in-part of application No. 29/305,273, filed on Dec. 27, 2011, now Pat. No. D713,131.

Publication Classification

(51) Int. Cl. A41D 13/04 (2006.01) A41D 13/00 (2006.01)

(57) ABSTRACT

An hands-free string-less apron is provided, comprising upper and lower sections constructed of a flexible, elastic, such as stretchable, plastic material. The upper section includes a neck strap for resting behind the neck of a wearer, and the upper section is intended to cover the abdomen of the wearer. The lower section is attached to the upper section, and the upper and lower sections are connected by an elastic waist band extending along the top edge of the lower section. The lower section completely surrounds the wearer's legs of the wearer when in a closed configuration. The lower section includes a closure device, such as zipper, extending substantially vertically between the elastic waist band and the bottom edge of the lower section. Optionally, a snap fastener is also located on the waist band to assist in closing the apron around the wearer.



2015/0000001

CLAIMS

1. An apron constructed from a flexible material, comprising (a) an upper section shaped and dimensioned to substantially cover the abdomen of a wearer, (b) a lower section integrally attached to the upper section, wherein the lower section has a bottom edge extending below the knees of a wearer, and wherein the lower section is shaped and dimensioned to substantially surround the legs of the wearer when in a closed configuration, (c) an elastic waist band connecting the upper section and the lower section, wherein the elastic waist band completely surrounds the waist of the wearer when in a close configuration, (d) a neck strap attached to the upper section and the upper section adapted to rest behind the neck of the wearer; and (e) a closure device extending substantially vertically between the elastic waist band and the bottom edge, wherein the closure device is adapted to close the lower section.

2. The apron of claim 1, further including a fastener on the elastic waist band adapted to close the elastic waist band.

3. The apron of claim 1, further including a neck strap device.

4. The apron of claim 1, wherein the elastic waist band is an elastic fabric stitched between the upper section and the lower section.

5. The apron of claim 1, wherein the closure device is a zipper.

6. The apron of claim 1, wherein the flexible material is a fabric.

7. The apron of claim 1, wherein the flexible material is a plastic.

8. The apron of claim 1, wherein the flexible material is a plastic sheeting material.



©HATSUMI-TUSHIN CO.,LTD.



検索クエリー指定方法の改善 ～機能説明～

Japio-GPG/FXの検索手法として、項目検索と検索クエリーの2種類の指定方法があります。

検索クエリーでは検索タームコードと検索タームを組み合わせて複雑な検索式が作成できますが、項目検索と指定方法が異なる点や、演算子の指定に煩雑な点がある事などを改善し、指定が容易になるように改善いたしました。

①検索ターム指定の簡略化

【従来】TI:インクジェット AND TI:プリンタ ⇒ 【新規】TI:(インクジェット AND プリンタ)

②演算子指定の簡略化(AND→スペース、OR→+、NOT→-)

【従来】TI:インクジェット AND TI:プリンタ ⇒ 【新規】TI:インクジェット TI:プリンタ または
TI:(インクジェット プリンタ)

※【従来】の指定も可能です。



ハイライト機能の改善

～機能説明～

Japio-GPG/FXでは「Word-INDEXの用語検索項目」ではハイライトされませんでしたが、ハイライトするように改善しました。

これにより、近傍検索時やファセットでの絞りこみ時などで指定した用語がハイライトするようになりました。

※「Word-INDEXの用語検索項目」は以下の通りです。

TI_F(タイトル)、AB_F(要約)、CL_F(クレーム)、DS_F(詳細な説明)



表示機能の改善

～機能説明&画面例～

詳細表示画面から一覧表示に戻る際のリンクが分かりにくいとの指摘
がございましたので、改善を実施しました。

一覧表示へのリンクは「検索式」となっていた部分を「**一覧表示** 検索式」に修正しました。

Japio世界特許情報全文検索

検索結果
| 検索期間 | マニュアル | ポータル | 経過情報(最新・履歴) | しおり表示
検索 > **一覧表示** (:*) AND (CC:CN OR CC:EP ...) > 詳細表示

54,119,591件中1件目



ドイツ・フランス公報全文英語データの追加
～機能説明＆画面例～ 7/17リリース

7/17リリース

ドイツ公報・フランス公報の全文英語データを追加します。

(1976年以降の独英・仏英機械翻訳データです。)

今後、PCT公報とEP公報の独英・仏英機械翻訳データおよび各々の英日機械翻訳データを順次追加いたします。

[de]Flusseinstellvorrichtung
[DE] Flow Adjusting Device
出願人: (DISCO CORP./DISCO CORPORATION)
発明者: (SUNAGAWA TAKESHI/(SUNAGAWA, TAKESHI))
出願番号: (DE201410212453) [2014-06-27]
文献番号: DE102014212453A1 (DE102014212453A1) [2014-12-31] [公報PDF](#) [フロントPDF](#)
IPC: (F16L25/14)
ECLA:
CPC: F16K7/04; Y10T137/87877
優先権主張番号: JP20130136223

英語／中国語	日本語
<invention-title>	【発明の名称】
[de]Flusseinstellvorrichtung	
[DE]Flow Adjusting Device	
<abstract>	【要約】
[de]Eine Flusseinstellvorrichtung zum Einstellen der Flussrate eines in mehreren Röhren fließenden Fluids wird bereitgestellt. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet eine Röhrenkopplungsverbindung mit einem Verbindungskörper und mehreren Eingriffsvorsprüngen. Der Verbindungskörper weist mehrere Verbindungsoffnungen zum jeweiligen Verbinden der Röhren auf. Die Eingriffsvorsprünge sind an den inneren Umfangsoberflächen der Verbindungsoffnungen des Verbindungskörpers angebracht und wirken so, dass sie jeweils mit den äußeren Umfangsoberflächen der Röhren in Eingriff stehen. Die Flusseinstellvorrichtung beinhaltet ferner mehrere innere Hülsen, die äußere Durchmesser aufweisen, die jeweils den inneren Durchmessern der Röhren entsprechen, und dafür ausgelegt sind, jeweils in die vorderen Endabschnitte der Röhren eingepasst zu werden. Die inneren Hülsen wirken so, dass sie die Eingriffskräfte der Eingriffsvorsprünge, die ausfallen, wenn die Röhren aufeinander aufgelegt werden, aufnehmen können.	

16



ドイツ・フランス公報全文英語データの追加 ～画面例～

7/17リリース

<description>		【詳細な説明】
BACKGROUND OF THE INVENTION		
Field of the invention		
[0001] a flow adjusting device for adjusting the flow rate of a fluid. The present invention relates to, the flows in several tubes.		
Description of the state of the type		
[0002] In be more than roads designated a semiconductor device-Fabrication method, at the front of a substantially disk-like semiconductor wafer formed intersecting dividing lines, a plurality of regions to be formed thereby to divide, in each of which a plurality of components, such as ICs and LSIs,. The back surface of the semiconductor wafer is ground with a grinding device, so as to reduce the thickness of the semiconductor wafer to a predetermined thickness. Afterwards the semiconductor wafer along the streets Terminating with a cutting device or a laser processing device, to obtain thereby the individual components which are separated from one another.		
[0003] The grinding device for grinding the backside of a wafer, such as a semiconductor wafer, includes a chuck table for holding said wafer under suction, an abrasive with a grinding wheel for grinding the wafer held on the chuck table, wherein the grinding wheel is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the abrasive ground (see e.g. the exposed JP2005-153090).		
[0004] a chuck table Cutting device for separating a wafer into the individual components. The includes for holding the wafer under suction, a cutting means having a cutting blade for cutting the wafer held on the chuck table, wherein the cutting blade is mounted on a rotating shaft, and a cleaning means for cleaning said wafer with the cutting means cut (see e.g. the exposed JP2001-7058).		

日本語データは
今後追加予定です。